

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2003 年 10 月 23 日 (23.10.2003)

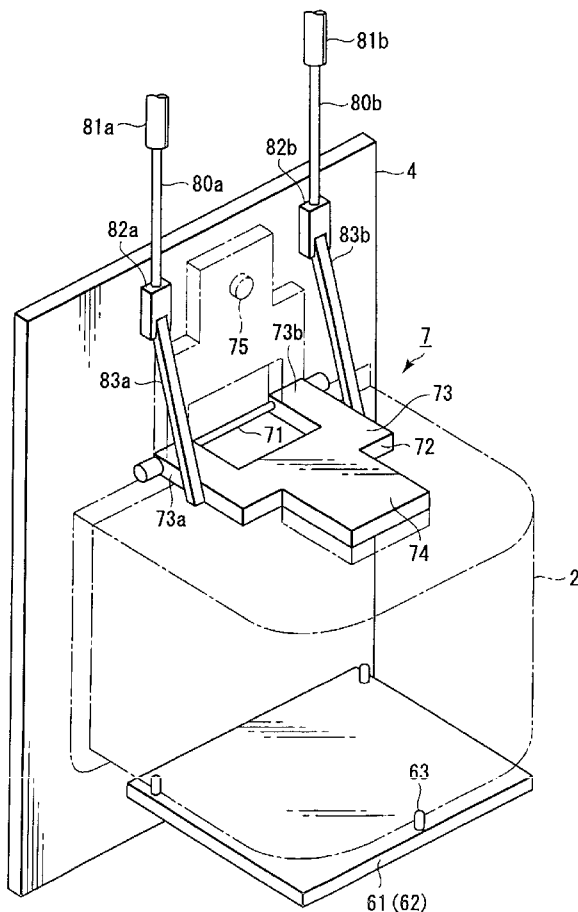
PCT

(10) 国際公開番号
WO 03/088351 A1

- (51) 国際特許分類⁷: H01L 21/68, B65G 49/00, 49/07, H01L 21/265, 21/324
- (21) 国際出願番号: PCT/JP03/03997
- (22) 国際出願日: 2003 年 3 月 28 日 (28.03.2003)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願2002-111114 2002 年 4 月 12 日 (12.04.2002) JP
- (71) 出願人: 東京エレクトロン株式会社 (TOKYO ELECTRON LIMITED) [JP/JP]; 〒107-8481 東京都 港区 赤坂五丁目 3 番 6 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 竹内 靖 (TAKEUCHI, Yasushi); 〒107-8481 東京都 港区 赤坂五丁目 3 番 6 号 東京エレクトロン株式会社内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 鈴江 武彦, 外 (SUZUYE, Takehiko et al.); 〒100-0013 東京都 千代田区 霞が関 3 丁目 7 番 2 号 鈴榮特許綜合法律事務所内 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (国内): CN, KR, SG.
- 添付公開書類:
— 国際調査報告書
- 2 文字コード及び他の略語については、定期発行される各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: PORT STRUCTURE IN SEMICONDUCTOR PROCESSING DEVICE

(54) 発明の名称: 半導体処理装置におけるポート構造



(57) Abstract: A semiconductor processing device has a port structure for carrying in and out a processing subject substrate (W). A partition wall (4) for separating the outer region (S1) and inner region (S2) of the device from each other is formed with a port (41) for passage of the processing subject substrate (W). The partition wall (4) is provided with a door (43) for opening and closing the port (41). A mount (61) is disposed within the outer region (S1) to face the port (41). Disposed above the mount (61) is a presser member (72). The presser member (72) presses a carrier vessel (2) for the processing subject substrate (W) from above onto the mount (61). The presser member (72) is moved between a lower position where it engages the carrier vessel (2) and an upper position where it does not interfere with the movement of the carrier vessel (2).

(57) 要約: 半導体処理装置は、被処理基板 (W) を搬出入するためのポート構造を有する。装置の外部側領域 (S1) と内部側領域 (S2) とを仕切る隔壁 (4) に、被処理基板 (W) を通過させるポート (41) が形成される。ポート (41) を開閉するように隔壁 (4) にドア (43) が配設される。外部側領域 (S1) 内でポート (41) に臨んで載置部 (61) が配設される。載置部 (61) の上方に押さえ部材 (72) が配設される。押さえ部材 (72) は、被処理基板 (W) のキャリア容器 (2) の上からキャリア容器 (2) を載置部 (61) に対して押し付ける。押さえ部材 (72) は、キャリア容器 (2) と係合する下側位置と、キャリア容器 (2) の移動と干渉しない上側位置との間で移動される。

WO 03/088351 A1